① 特許出願公開

# 平3-105841 ⑫ 公開 特 許 公報(A)

@Int.CI.5

識別配号

庁内整理番号

個公開 平成3年(1991)5月2日

49/26 27/62 H 01 J G 01 N

7247-5C 7529-2G

G

審査請求 未請求 請求項の数 25 (全14頁)

質量分析方法及び装置 会発明の名称

> 願 平1-242195 ②特

頤 平1(1989)9月20日 23出

彦 武 森 ⑫発 明 者 北

茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル

ギー研究所内

正 冶 明 坂 Ŀ ⑫発 者

茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル

ギー研究所内

正太佳 者 古 賀 個発 明

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

剛 水 個発 明 者 西 垂

茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那珂工場

株式会社日立製作所 勿出 顋 人

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

勝男 外2名 弁理士 小川 四代 理 人

最終頁に続く

1. 発明の名称

質量分析方法及び装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 試料をイオン化し、発生したイオンを受量分 析する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせるとともに、レーザ光の出力密度をブ レイクダウンにより発生するイオンが低荷電数 のイオンとなるように調整し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

2、 試料をイオン化し、 発生したイオンを質量分 折する費量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせるとともに、レーザ光の出力密度をブ レイクダウンにより発生するイオンが主に単一 電子数のイオンとなるように調整し、該イオン を質量分析することを特徴とする質量分析方法。

3.試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 析する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせてプラズマ化し、築プラズマから原子 発光線または低荷電数のイオンの発光線が発生 したときにイオンを引き出し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

4.試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 折する費量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせてプラズマ化し、前記プラズマ中のイ オンが単一電子数または低荷電数のイオンにな るまでの時間を経過した後中性原子になるまで 間にプラズマからイオンを引き出し、該イオン を質量分析することを特徴とする質量分析方法。

5.試料をイオン化し、発生したイオンを質量分 折する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダ ウンさせてプラズマ化し、旗プラズマから原子 発光線または低荷電数のイオンの発光線を観測 したときにイオンを引き出し、該イオンを質量 分析することを特徴とする質量分析方法。

6. 特許請求の範囲第5項記載の資量分析方法において

前記イオンの引き出しは、前記原子発光線または低荷電数のイオンの発光線の強度が所定の設定値を越えたときに行うことを特徴とする質量分析方法。

7. 試料をイオン化し、発生したイオンを質量分析する質量分析方法において、

試料にレーザ光を照射して試料をブレイクダウンさせてプラズマ化し、前記プラズマ中のイオンを飛行時間型質量分析計で単一電子数または促荷電数のイオンとして質量分析することを特徴とする質量分析方法。

8. 関体試料をイオン化し、発生したイオンを質量分析する質量分析方法において、

固体試料に出力密度が1010~10<sup>11</sup>W/cd のレーザ光を照射して固体試料をプレイクダウ ンさせてイオン化し、該イオンを質量分析する ことを特徴とする質量分析方法。

8、被体試料をイオン化し、発生したイオンを質

気体試料に該気体試料中の披摘状物質はブレイクダウンするが気体はブレイクダウンしない 出力速度のレーザ光を照射し、前配液液状物質 がプレイクダウンしたときに発生したイオンを 質量分析することを特徴とする質量分析方法。

13. 試料をイオン化し、発生 した イオンを収量 分析する質量分析方法において、

試料を挟んで配置した電極により試料に電圧 を印加して試料をプレイクダウンさせるととも に、印加する電圧をプレイクダウンにより発生 するイオンが低荷電数のイオンとなるように調 致し、該イオンを質量分析することを特徴とす る質量分析方法。

14、試料をイオン化するイオン 化 部、 線イオン 化部で発生したイオンを費量分 折 する 質量分析 部から成る費量分析装置において、

前記イオン化部の試料をイオン 化 させる手段 として、前記試料にレーザ光を 照 射 したときに 試料がブレイクダウンするとと も に 該 ブレイク ダウンにより発生するイオン が 低 荷 電 数 のイオ 量分析する質量分析方法において、

被体試料に出力密度が10<sup>11</sup>~10<sup>12</sup>W/cli のレーザ光を照射して被体試料をプレイクダウ ンさせてイオン化し、該イオンを質量分析する ことを特徴とする質量分析方法。

10、気体試料をイオン化し、発生したイオンを 費量分析する質量分析方法において、

気体試料に出力密度が1012~1018W/cl のレーザ光を照射して気体試料をプレイクダウ ンさせてイオン化し、誤イオンを質量分析する ことを特徴とする質量分析方法。

11. 試料をイオン化し、発生したイオンを質量 分析する質量分析方法において、

気体又は被体試料に設気体又は液体試料中の 粒子状物質のみがプレイクダウンする出力密度 のレーザ光を照射し、前記粒子状物質がプレイ クダウンしたときに発生したイオンを質量分析 することを特徴とする質量分析方法。

12、試料をイオン化し、発生したイオンを質量 分析する質量分析方法において。

ンとなるようにレーザ光の出力密度を調整した ・レーザ光照射装置を用いることを特徴とする質 量分析装置。

15. イオン発生用の試料を収容する装置と.

前記試料にレーザ光を照射して試料をブレー クダウンさせてプラズマ化させるレーザ光照射 熱質ト

前記プレイクダウンさせたときのプラズマ中 のイオンが単一電子数または低荷電数のイオン になるまでの時間を経過した後中性原子になる まで間にプラズマからイオンを引き出す装置と、

該引き出されたイオンを質量分析する手段と を有することを特徴とする質量分析装置。

16. 特許請求の範囲第14項または第15項に 記載の質量分析装置において、

前記費量分析部(費量分析する手段)が飛行時 間型費量分析計であることを特徴とする費量分析装置。

17、イオン発生用の試料を収容する装置と、 前記試料にパルスレーザ光を照射して試料を ブレークダウンさせてプラズマ化させるレーザ 光服射装置と、

前記プレイクダウンさせたときのプラズマ中 のイオンが単一電子数または低荷電数のイオン になるまでの時間を経過した後中性原子になる まで間にプラズマからイオンを引き出す装置と、

該引き出されたイオンを収量分析する飛行時 関型費量分析計と

を有することを特徴とする質量分析模型。

16. 特許請求の範囲第17項に記載の質量分析 装置において、

前記イオンを引き出す装置は、イオン取り出し電機を有し、前記パルスレーザ光を照射する時刻より所定の設定時間遅らせてイオン取り出し電価に電圧を印加するようにしたものであることを特徴とする質量分析装置。

18. 特許請求の範囲第17項に記載の費益分析 装置において、

前記イオンを引き出す装置は、イオン取り出 し電福と、プラズマ発光を分光測定する装置を

前記試料は気体又は液体試料であり、

前記レーザ光照射装置から前記試料に照射されるレーザ光の出力密度は、前記気体又は液体 試料中の粒子状物質のみがブレイクダウンする 出力密度となるように調整されたものであることを特徴とする質量分析装置。

23. イオン発生用の試料を収容する装置と、

前記試料にパルスレーザ光を限射して試料を ブレークダウンさせて プラズマ 化させるレーザ 光照射装置と、

前記プレイクダウンさせたときのプラズマか らイオンを引き出す数置と、

該引き出されたイオンを質量分析する飛行時 簡型質量分析計と、

前記飛行時間型度量分析計のイオンデフレクタを前記レーザ光限射装置のパルスレーザ光の 照射時期と対応させて作動させる装置と、

前記イオンデフレクタの作動時期に対応させて検出したイオン電流を信号処理する数数と を有することを特徴とする質量分析数置。 有し、該分光測定装置で原子発光線または低荷 電散のイオンの発光線が観測されたときに前記 イオン取り出し電極に電圧を印加するようにし たものであることを特徴とする質量分析装置。

20. 特許請求の範囲第19項に記載の質量分析 装置において、

前記イオン取り出し電極への電圧の印加を前記原子発光線または低荷電数のイオンの発光線の強度が所定の設定値を越えたときに行うようにしたことを特徴とする質量分析装置。

21. 特許請求の範囲第15項または第17項に 記載の費量分析装置において、

前記試料を収容する装置は、液体又は気体試料を絞り込む機構を有し、前記レーザ光照射装置は、前記液体又は気体試料を絞り込んだ個所に試料がプレイクダウンする出力密度のレーザ光を照射するようにしたことを特徴とする質量分析装置。

22. 特許請求の範囲第14項または第15項または第17項に記載の費量分析装置において、

- 2.4. イオン発生用の試料と、 該試料にレーザ光 を照射したときに試料がプレイクダウンすると ともに該プレイクダウンにより発生するイオン が低荷電数のイオンとなるようにレーザ光の出 力密度を調整したレーザ光照射装置とを有する ことを特徴とするイオン源。
- 25. イオン発生用の試料と、該試料にレーザ光を照射して試料をプレイクダウンさせてプラズマ化するレーザ光照射装置と、前記プラズズ中のイオンが単一電子数または低力のイオンになるまでの時間を経過した後中性原子になるまで間にプラズマからイオンを引き出す装置とを有することを特徴とするイオン源。
- 3、発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は質量分析方法及びその装置に係り、特にレーザ光により試料をイオン化することにより 質量分析する方法及び装置に関する。

[従来の技術〕

従来の質量分析装置では、イオン化に例えばグ

ロー放電を用いた大気圧イオン化法などが用いられている。しかし、この方式ではイオン化できるのは気体試料に展立されていた。

また、レーザをイオン化部に用いた質量分析装置として、例えば第23回応用スペクトロメトリ東京討論会講演要音集の第93,135及び137頁(1888)に記載されているものがある。これらは、試料にレーザ光を照射して試料をイオン化するもの、原射するレーザ光の光出力は小なイオンの高体の影響を受け、大力を照射して関係の単純なイオンを発生させているにすがないものであった(後述するレーザブレイクダウンには到っていなかのた)。そのため、固体表面の分析などに分析対象は限定されていた。

また、レーザ光を試料に照射してイオンを発生 させて各種処理操作をする方法として以下に述べ るようなものがある。

特公昭58-46340 号公報には、レーザ光線をターゲットに限射しターゲット材をイオン化してイオンを質量分光により同位体分離する方法につい

特別昭50~78384 号公報 10~78384 号公報 10~7838 10~883 10~88

図ドイツ特許公開公報第 252010号 にはレーザ蒸 着製置で生成したプラズマ中のイオンを質量分析 計で分析する方法について記 殺されている。レー ザ素者装置では、基板上に森 君 させる物質の材料 にレーザ光を照射してその物質を 森 発させ原子ま

て記載している。この方法は、同位体の分離を目 的としたものであり、高い効率でターゲントをイ オン化するように極めて高強度のレーザ光線を使 用し、発生したイオンも単一電子の荷電状態の10 **掛以上の高荷電状態となるようにしている。この** ため生成したプラズマ内では、同一元素に対し10 以上の異なる荷電状態をもつことになり、これを 費量分析計で同位体分離すると、関一元素に対し その荷電状盤に応じて2/m(2はイオン餌敷, mは質量)が異なるため別々のデポジツタ(同位 体補集器)に分離して補集されることになる。タ ーゲント材料の組成分析においては、同一元衆が 質量分析計の同一補集器に補集できれば高感度と なるが、この例では元素が同一でも荷電状態によ り別々の補集器に補集され、虫た、異なる元素で 同一の2/mの値をもつ荷電状態のイオンは同一 の補集器で補集される。このため、この方式のイ オン化の方法は、本発明の目的である材料の組成 分析に必要な質量mのみの分離定量には適切では ない。

たは分子状にする。このとき森発した原子や分子 の一部がレーザ光の照射を受けて電離しイオンに なる。通常はこのイオンや原子・分子は囲りのイ オンや原子・分子と衝突して合体し微小なクラス ターを形成するが、このうち電荷をもつたクラス ターやイオンが世極により引き出され指板上に導 かれ、付着して確膜を形成する。この蒸発したガ ス中には中性の原子・分子及びそれらのクラスタ ー、及びこれらの電離されたイオンが混在してい るのが通例である。森着物質の質量や荷電数を観 祭するため、イオン成分を質量分析計に導き質量 分析している。この質量分析では、蒸着過程で生 成した蒸発原子、分子・イオン及びそのクラスタ ーの中のイオン成分を利用するものであり、材料 の元素分析(原子組成分析)を目的として材料を 稜矢的にかつ効率よく原子状にしかつイオン化し て党量分折するものではない。

## [発明が解決しようとする課題]

上記費量分析における従来技術では、 質量分析 する対象が気体や固体表面に限られており、質量 分析の対象を広げることができないという問題が ある。

また、上記レーザ光を用いて試料をイオン化し、各種処理操作を行う従来技術では、材料の組成分析を行う質量分析には適さない。 即ち、これらの従来技術を質量分析の分野に適用しても、レーザ光照射により分析対象とする材料をイオン化する際、質量分析に適する低荷電状態のイオンが効率よく生成されないという問題がある。

また、上記従来の技術では、例えば、被体や気体中の粒子成分を分析する際に粒子成分のみを選択的に、かつ効率よくイオン化する点に配慮されておらず、固体、被体、気体など種々の形態の材料を高慮度に成分分析することが困難である。

なお、従来、レーザ光を用いて飲料を分析する 方法として、レーザプレイクダウンを用いる分析 方法があが、レーザプレイクダウンを用いる分析 方法では、例えばジヤパニーズ・ジヤーナル・オ ブ・アプライド・フィジックス、27、(1988年) 第 L983頁~第L985頁(Japanese Journal of

したイオンを小型で簡便な袋鼠により費量分析する方法及び袋鼠を提供することにある。

本発明のさらに他の目的は、質量分析等に好遊な低荷電数のイオンを効率よく生成するための分析対象等のイオン化の装置を提供することにある。
(課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、質量分析の対象物質(試料)のイオン化の方法として、レーザ光照射により分析対象物質の一部または全部をブレイクダウン(絶縁破壊の一種) させる方法を用いる。

また、試料にレーザ光を照射して試料をブレイ クダウンさせるときのレーザ光の出力密度をブレ イクダウンにより発生するイオンが低荷電数のイ オンとなるように調整する。

また、パルス状のレーザ光を照射して分析対象 物質を瞬時にプレイクダウンさせプラズマ化した 後、生成した高荷電数のイオンが電離した電子と 再結合して単一電子敷または低荷電数のイオンに なるまでのある時間を経過した後、プラズマ中の イオンを取出し、質量分析装置に導く。 Applied Physics 27,(1988)pp.L983ーL985)に記載のように発生する音響波を用いて被体中の微粒子を計載したり、また、アプライド・スペクトロスコピー38(1984年)第721頁~第729頁(Applied Spectroscopy 38,(1984)pp.721-728)に記載のように、レーザブレイクダウンにより発生したプラズマ発光を分光して被体の成分分析をしており、レーザブレイクダウンにより発生するイオンを用いて質量分析をしていなかつた。

本発明の目的は、分析対象が限定されない實量 分析方法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、質量分析に好適な単一電子数またま低荷電数のイオンのみを効率よく得て 質量分析する方法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、固体や被体、気体、又は 液体や気体中に含まれる固形状物質(粒子状物質) を選択的にイオン化して高感度で質量分析する方 法及び装置を提供することにある。

本発明の他の目的は、瞬時にイオン化して生成

また、固体や液体、気体、あるいは液体や気体に含まれる粒子状物質に対し、それぞれの対象をブレイクダウンに到らせるに必要なレーザ光の出力密度の出きい値に姿があることを利用して、レーザ光の出力密度を適切に設定することにより、固体、液体、気体のうちの特定の形態の物質を選択的にブレイクダウンさせる。

さらに、パルス状のシーザ光照射により分析対象物質をプレイクダウンさせプラズマ化して生成したイオンを飛行時間型質量分析計により質量分析する。

さらに、レーザ光照射によりブレイクダウンし て発生するイオンは質量分析以外にも広い分野で イオン額とすることができるため、このイオン化 法をイオン加速器などのイオン顔とする。

### [作用]

パルス状のレーザ光などを凸レンズなどにより 集光し、光出力密度を10<sup>10</sup>W/d以上にして物 質に照射すると、物質はレーザ光の熱的及び光学 的ならびに電磁気的作用により一瞬にして破壊し プラズマ化する。この現象をレーザブレイクダウンと呼ぶ。レーザプレイクダウンにより生成したプラズマ中にはイオンと電子が混在する。したがつて、レーザプレイクダウンにより物質をイオン化することができる。発生したイオンはプラスマ中で電子と再結合して中性原子となる前にイオンを取出し質量分析する。

第13回に、棺被試料にパルスレーザ光を照射してイクダウンさせプラズマ化したとを発生するプラズマ発光の経時変化を分光測定はである。この測定結果によから関係することがある。このを対することがある。このを対することがあり、この時間がイマを取り出して質量分析することが、プラスズのにはある。プレイクダウン直接にプラスズを明され、それより約300mを及び、それよりが開きに変更を表現した。このには、1000円を表が観測される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が明瞭に複類される。NaのD線)が可能に複類を表現した。NaのD線)が可能に表現した。NaのD線)が可能に対したと思いませんである。NaのD線)が可能に対している。NaのD線)が可能に対しているでは、NaのD線)が可能に対しているでは、NaのD線)が可能に対しているのでは、NaのD線)が可能に対しているのでは、NaのD線)が可能に対しているでは、NaのD線)が可能に対しているでは、NaのD線)が可能に対しているのでは、NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対しているNaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対したがでは、NaのD線)が可能に対したがでは、NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線)が可能に対した。NaのD線の表現をNaのD線の表現象別のでは、NaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのD線の表現をNaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでは、NaのDkintでNaのDkintでは、NaのDkintで

ブレイクダウンプラズマが生成された後、原子 発光線が観測され始める時点でプラズマに併えば 電磁気力などを作用させれば、1 値イオンを効率 よく取出すことができる。

次に、物質をブレイクダウンさせるために必要 なレーザ光の出力密度は、物質の形態すなわち固 体、液体、気体のそれぞれに対して異なる。光出 力密度が10<sup>10</sup>Ψノdレベルで固体のレーザブレ イクダウンが生じ、1011W/cdレベルで液体の、 1012₩/ピレベルで気体のシーザブレイクダウ ンが起る。したがつて分析対象の試料の形態に応 じて光出力密度を適当に設定することにより、分 析対象を選択的にプレイクダウン し、イオン化す ることができる。とくに、光出力密度を液体のブ レイクダウンしきい値より小さい 1 O 10 W / ol程 度とすると固体のみをブレイク ダウン することが できる。したがつて、この光出力密度で気体また は液体試料にレーザ光を照射すると媒質はブレイ クダウンせずに媒質中の粒子 状物 熨 の み を ブレイ クダウンさせることができる。 した がつ て、レー

溶液のブレイクダウン直後ではNaは1価または 低価数のイオンとなり種々の励起状態となりうる ため、励起状態に応じてそれぞれ異なる波長の光 を放出し、その結果白色光が概図される。ブレイ クダウン発生後の時間の経過に伴つて、多額イオ ン状態のNaが電子と結合しNaの1 師イオンが 生成し、このNaのI価イオンと電子が再結合し て中性Na原子になつた際結合した電子が基底状 想に運移してNaの原子発光線 (D線)を放出す る。第13週では、約300n秒経過後より原子 発光線が明瞭に観測されており、ブレイクダウン により発生したプラズマの消滅過程でNaの1価 イオンが多数生成されることがわかる。また、ブ レイクダウン後約300n秒の短時間が経過した 時点でつよいNa原子発光線を表現したことは、 この時点までの短時間の間にすでに多数のNal 価イオンが生成していることを意味し、このよう なプレイクダウンプラズマでは1価または2価程 度の低荷電数のイオンが多数生成していると考え Sho.

ザ光の出力密度を1010W/ご程度とすることにより、気体や液体中の粒子状物質を選択的にイオン化し、質量分析することができる。さらに、レーザプレイクダウンでは物質が源体、半導体、結合体であつてもプレイクダウンによりイオン化できるため、気体や液体中の金属や酸化物など広い範囲の化学形態の物質をイオン化することが可能となる。

以上から、レーザプレイクダウンによる固体表 面のみならず、気体や液体、さらにそれらに含ま れる粒子状物質もイオン化することができ、質量 分析法の適用範囲を著しく拡大することができる。

イオン化はレーザ光の照射により起り、レーザブレイクダウンに必要な光出力密度を得るためにレーザはパルス発掘とすることが多い・したがつて、パルス的に発生するイオンを分析するため、質量分析にはレーザ光のパルス発掘と同期としてが動させることが可能な飛行時間型質量分析法望しい。この方式では、パルスレーザ光を照引し分析対象物質をブレイクダウンさせ、発生するブ

ラズマ中のイオンを例えば電圧を印加した電極等により引出し、飛行時間型質量分析計に導く。電極の印加電圧をVとすると、質量m,荷電数(質数)qのイオンの速度vは(1)式により与えられる。

$$\frac{1}{2} m v^{1} = q V \qquad \cdots (1)$$

したがつて、飛行距離Lの飛行時間型質量分析 計において、イオンの飛行時間では (2)式のよう になる。

$$T = \frac{L}{v} = \sqrt{\frac{m}{2 q V}} \cdot L \qquad \cdots (2)$$

$$\therefore \frac{m}{q} = \frac{2 T^{\frac{1}{2}} V}{T^{\frac{1}{2}}} \qquad \cdots (3)$$

したがつて、プレイクダウンの発生時刻からイオンの検出時刻での時間でを認定することとにより(2)式を用いて、イオンのm/qを得ることとができる。とくに1価イオン(q=e, eはとかの電荷量)のとき、Tとmは1対1の関係にあずり、飛行時間でを測定すればイオンの質量 m なお、飛行時間でを測定するための時刻の起点として、パルスレーザの発振時刻またはパルスレーザの発振時刻またはパルスレーザの発振時刻またはパルスレーザの発振時刻またはパルスレーザの発振り

パルス市10ns,出力100mJのレーザ光 13は集光レンズ2により収束させ、気体用ブレ イクダウンチェンパ3に入射する。レーザ光13 はプレイクダウンチェンパ3の内部で焦点を結び、 焦点付近で気体のレーザブレイクダウンを誘起す る。レーザプレイクダウンによりイオン化する気 体試料は試料導入路4を通つてブレイクダウンチ エンパ3に導かれ、排出される。プレイクダウン チェンパ3内でレーザブレ イクダウンによりプラ ズマ化され、イオン化された気体試料の構成原子 はブレィクダウンチェンパの スリツトを経て加速 電極 5 により加速され、飛行時間型質量分析装置 (TOP) のイオンディフ レクタ 6 に導入される。 イオンディフレクタ6は パル スYAGレーザ1と 両期して作動し、レーザブ レイクダウンによる気 体試料のイオン化と同時に 生成 したイオンをイオ ンコレクタフに導入する。 イ オンコレクタフから のイオン電流11はイオン デ イ フレクタ6の作動 開始時期を基準として信号 処理 装置 9 により処理 され、飛行時間質量スペク トル (TOFスペクト

選時刻、またはプラズマ発光の観題時刻、もしくはこれらの時刻よりある一定時刻遅れた設定時刻などを選定すればよい。また、プラズマからイオンを取出すための電極への電圧印加のタイミングとして、パルスレーザ光の照射前の任意の時刻、またはプラズマ発光に原子発光線や1 価または低価数のイオンの発光線を観測した時刻などを選定する。

レーザブレイクダウンにより発生するイオンを加速器などのイオン源として利用することもできる。レーザブレイクダウンにより様々な形態の試料をイオン化することができ、また、元素の種類によらずイオン化することができる。したがつて、レーザブレイクダウンにより広い範囲の物質をイオン源とすることができる。

#### (实旅例)

以下、本発明の一実施例を第1回から第12回 により説明する。

第1回は本発明の基本構成図を示す。パルス YAGレーザ1から発生する放長1064 nm,

ル)を得る。パルス発生器 8 はパルス Y A G レーザ1。イオンデイフレクタ 6 及び信号処理装置 9 を同期して作動させるための制御信号 1 0 を発生させる。

第2回は本発明の別の実施例である。 第1回と のちがいは、借号運延制御装置31と電圧印加装 置32及びイオン取出し電揺33を設けた点にあ る。信号運延制御装置31によりパルス発生器8 でのパルス信号発生の時刻よりある設定時間だけ 遅らせた時刻に電圧印加数置32を作動させイオ ン取出し電摄33に電圧を印加させる。プレイク ダウンチェンパ3内で液体試料がパルスレーザ光 の照射によりプレイクダウンされプラズマ化して イオン化した被体試料の構成原子が、電摄33に 電圧を印加した時点で引出され、加速電橋 5 によ り加速され、飛行時間型質量分析装置のイオンデ イフレクタ6に導入される。この方法により、試 料がプレイクダウンしてプラズマ化した後ある数 定時間の後にプラズマ中のイオンを引出して質量 分析することができる。電圧印加装置32を作動 させるタイミングとして、第2回の実施例以外に プラズマ発光を分光調定し、原子発光線または1 飯1イオンの発光線の強度がある設定値を越える かどうかを判定し、発光線強度が設定値を越えた 時刻で作動タイミングを与えてもよい。

第3回は本実施例の真空系の標成を示す。ブレイクダウンチェンパから成るイオン化部14は大気圧であり、加速電極を含む差動排気部15はターボ分子ポンプ17により10<sup>1</sup> Paに排気され、さらにTOPから成る質量分析部16は10<sup>-2</sup> Paに抑気される。したがつて、本実施例では大気圧下で生成したイオンは高真空側に導入され、質量分析される。

第4回は気体試料用のブレイクダウンチェンバ 3の構造を示す。気体試料は試料導入路4を通つ てプレイクダウンチェンバ3に導入される。レー ザ光13は集光レンズ2により収棄し、光学窓 18よりプレイクダウンチェンバ3内に照射し、 再び光学窓18を経てブレイクダウンチェンバ3 の外側に設置されたピームストンパ12により吸

光13は集光レンズ2により集光され、光学窓 21よりプレイクダウンチェンパ 20に導入され る。レーザ光は円錐状のブレイクダウンチエンバ 20の内壁面に沿つて集光され、 ブレイクダウン チェンパ20の細口よりチェンパ外へ出たところ で編点を結ぶ、したがつて、 ブレイクダウンチエ ンパ20の下部組口を出た試料の細口流れの途中 ででレーザ光は焦点を結び。 試料 のプレイクダウ ンが誘起される。このように して 被 体 試料は大気 中でレーザブレイクダウンに よ り イ オン化される。 この液体用のプレイクダウン チ エ ンパ は第 1 図に おける気体用のブレイクダウ ン チ エン パ3に置き 換えて使用する。 焦点における レーザ光の出力密 度を10<sup>11</sup>W/d以上に設定すると被体試料をブ レイクダウンしイオン化する こ と ができ、被体の 成分分析が可能となる。また、 燉 点 に おける シー ザ光の出力密度を1010W/calkに設定すると液体 中の粒子状物質のみをブレイ グ ダ ウ ン し・イオン 化することができる。 したがつ て、 この条件下で は、被体中の粒子状物質のみ成 分 分 折 することが

収される。無点付近でレーザ光の出れる。無点付近でレーザ光るためには近で の が が か が か が が か が が か が が か か で を な か で き る ことがで き る ことがで き る に か の 物質を か が で き る に か か で き る に か で き な か で き る に か で き な か で き る に か で き な か で き な か で き る に か で き な か で か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で き な か で か で き な か で か で き な か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で き な か で か で き な か で か で か で か で か で か

第5回は液体試料用のプレイクダウンチエンパの構造を示す。液体試料は試料導入管19を経て円錐状のプレイクダウンチエンバ20に激入される。円錐状のプレイクダウンチエンバ20に激入される。半学窓21となり、下部は綴口が開いており、液体試料はこの細口を経て優めて鎖い流れとなり、試料排出管22より排出される。レーザ

できる.

第5 図では、ブレイクダウンチエンバ20の下部組口を出た液体の短い流れの部分にレーザ光の 焦点を結ばせてブレイクダウンさせたが、この代りに、下部組口27を出た液体試料の液滴にレーザ光の焦点を結ばせて液体試料をブレイクダウン させてもよい。また、レーザ光を液体試料の上部 から 限 射する代りに、水平方向から液体試料の細い流れまたは液滴に焦点を結ぶように 照射して液体をブレイクダウンさせてもよい。

第6 図は図体試料用のブレイクダウンチエンパの構造の例を示す。ブレイクダウンチエンパ2 6 内に設置した試料台2 3 上に図定し、焦点レンズ2 5 で収取させたレーザ光1 3 を試料に照射する。図体表面は10°~10 LLW / clの光出力密度でプレイクダウンに到るため、レーザ光の出力密度もこの範囲に設定する。図体用プレイクダウンチェンパ3と置き換えて使用する。

第7図には固体試料用のブレイクダウンチエン

パの別の実施例を示す。この実施例では、試料台23を移動して試料24の任意の位置にレーザ光を照射できるようにするため、試料台駆動制御装置44を設けている。

第10回に飛行時間型質量分析装置の一実施例を示す。プレイクダウンにより発生したイオンは イオン飛行チューブ51内に設置されたイオン取

ンは電信 6 4 で生じた電界により反発 6 3 を通行方向を遊むさせる。イオンが配信 6 3 を通過して電信 6 4 の方向に進み、進行に 意味 6 1 の電信 6 2 により電信 6 1 の電信 6 1 の電信 6 2 により電信 6 1 の電信 6 1 の電信 6 2 にとせ 位を 変 で とせ に 立 た 方 で 再 皮 遺行 で さ せ せ で さ せ せ で さ さ せ む 方 な で す な が 長 く な る た か 質 を 加 で れ か 長 く な る た か 質 か で れ か た か の か に で ま な な な か が 大 か で れ か の か の か の か の か の と と も に 、イオン 飛行 チューブを 小型 化 で き る メリットがある。

液体をブレイクダウンし、イオン化する別の方法の実施例を第12回に示す。 液体容器 70の下部はロード状で、その先端に相孔 が設けられている。容器下部組孔から流出した 細線 伏 車 たは液液状の試料液体は、対向して設けられた 電極 71の関膜を通り落下する。電極 71に は、 電圧 印加制 御袋買73からの制御信号により 征源 72を作動

第11関には飛行時間型質量分析装置の別の実施例を示す。イオン飛行チューブ51内には電框52及び53の他に、新たに電極61。63。64及び電径61の電圧制御装置62が設けられている。イオンデイフレクタ53を通過したイオ

させ、パルス状に高電圧を印加する。電極71への印加電圧として絶縁破壊したい電圧(約10<sup>8</sup> V/cu 程度)を上まわる値に設定する。

第14回はレーザ光により試料をイオン化させた実施例において測定した気体中の粒子状物質のTOFスペクトルを示す。TOFスペクトルには質量数28のSi及び質量数16のOのピークが主として検出され、粒子状物質の主たる成分がSiOxであることがわかる、また、質量数44のピークはSiOxのピークはSiOxでのピークはSiOxでのピークと関定される。

本実施例において、TOFによる費量分析部を イオン加速器とすることにより、ブレイクダウン チエンバを加速器のイオン派として使用すること もできる。

### (発明の効果)

本発明によれば以下の効果がある。

- 1) 気体、液体、固体等試料の形態を問わずイオン化でき、分析することができる。
- 2) 気体中、あるいは液体中の粒子状物質を選択

的にイオン化し、分析することができる。

- 3) 絶縁体。毕藤体、湛体等試料の性質を問わず イオン化でき、分析することができる。
- 4) イオン化ポテンシャルの高い物質でも容易に レーザブレイクダウンに到るためイオン化でき、 分析することができる。
- 6) レーザブレイクダウンにより1個または低荷電数のイオンを効率よく生成することができ、 高速度の分析が可能である。
- 6)上記1)~4)に記載の形態及び性質の物質 をイオン化することができ、それらを加速器等 のイオン額とすることができる。
- 7)上記1)~4)に記載の形態及び性質の物質でも微量成分分析ができる。
- 8) レーザ光の光出力密度を変化させることにより分析対象物質を選択することができる。
- 5) レーザ光の光出力密度を変化させることにより。成分分析を元素分析、あるいは分子の分析とすることができる。
- 10) レーザブレイクダウン独と飛行時間型質量分。

61,63,64 …電極、62 … 健圧制御装置。

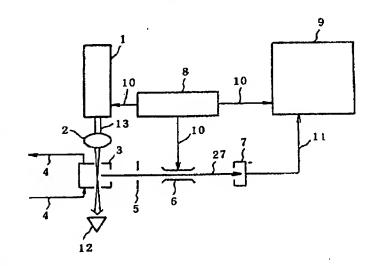
代理人 弁理士

析法の組合せにより、小型で低コストの高感度 成分分析が可能である。

## 4. 図面の簡単な説明

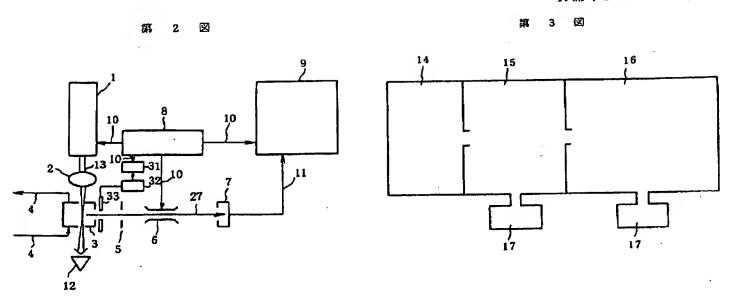
1 … パルスYAGレーザ装置、2 … 集光レンズ、3 … プレイクダウンチエンバ、4 … 試料導入路、5 … イオン加速電径、6 … イオンデイフレクタ、7 … イオンコレクタ、8 … パルス発生掛、9 … 信号処理装置、10 … 制御信号、11 … イオン電流、

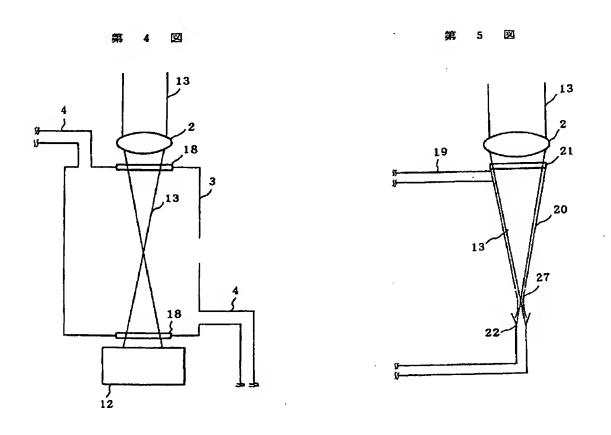
第 1 図



小川野寒

特別平3-105841 (11)

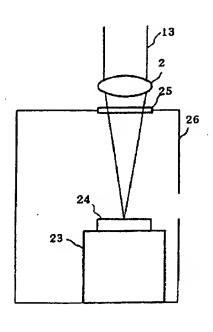


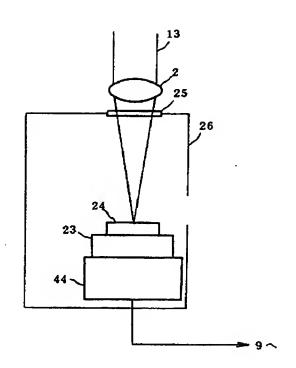


特閒平3-105841 (12)

第 6 図

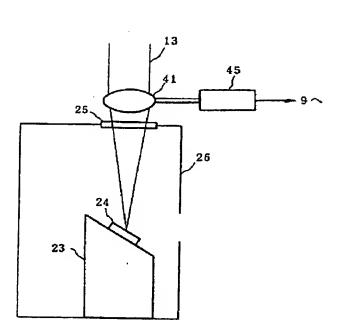


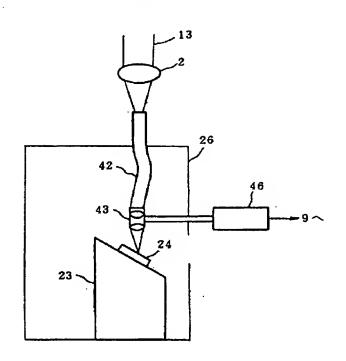






第 9 図

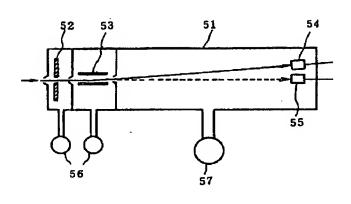


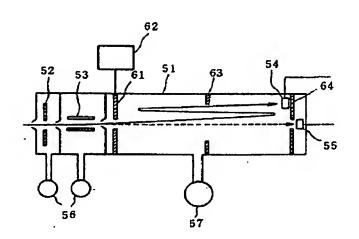


特閒平3-105841 (13)

第 10 図

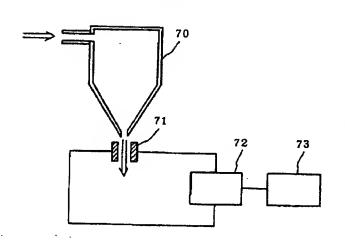
第 11 図

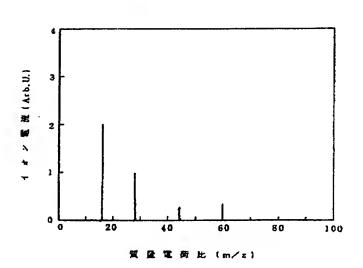




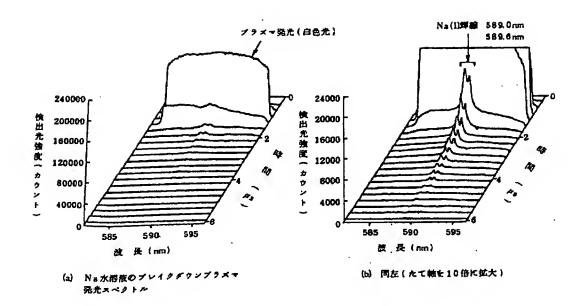
第 12 図

红 14 区





第 13 図



第1頁の続き @発 明 者 松 井 哲 也 茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル ギー研究所内 @発 明 者 横 瀬 賢 次 茨城県日立市森山町1168番地 株式会社日立製作所エネル ギー研究所内